

## ファインMEMSプロジェクト中間成果発表会

### (1) 開催主旨

MEMS産業の発展を支える基盤技術として、平成18年度から3年間の予定で実施中のNEDOプロジェクト「高集積・複合MEMS製造技術開発プロジェクト」(ファインMEMS:微小三次元化構造加工の高度化と、ナノ部材・異種材料の活用による機能の複合化・集積化を図るための製造基盤技術を開発)の中間成果を紹介します。

### (2) プログラム

NEDO委託・助成「高集積・複合MEMS製造技術開発事業」(平成18年度～平成20年度)

## ファインMEMSプロジェクト中間成果発表会

開催日時 2008年7月31日(木)12:30～16:30  
 開催場所 東京ビッグサイト 西1ホール 第19回マイクロマシン/MEMS展会場内 特設会場  
 主催 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構/(財)マイクロマシンセンター  
 後援 経済産業省(予定)  
 参加費 無料(座席200席)および予稿集には数に限りがありますので、先着順とさせていただきます)

<b>セッション1</b>	<b>オープニング</b>	司会:(財)マイクロマシンセンター MEMSシステム開発センター センター長 小池 智之
12:30～12:35	主催者挨拶	(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事 上原 明
12:35～12:50	MEMS産業戦略とファインMEMSプロジェクトへの期待	経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐 是永 基樹
12:50～13:10	ファインMEMSプロジェクトの概要	ファインMEMSプロジェクト プロジェクトリーダー 東京大学大学院 情報理工学系研究科 研究科長 教授 下山 勲
<b>セッション2</b>	<b>ファインMEMSプロジェクト委託事業の成果発表(1)</b>	司会:東北大学 教授 小柳 光正
13:15～13:35	選択的ナノ機構構造体形成技術	東京大学大学院 情報理工学系研究科 研究科長 教授 下山 勲
13:35～13:55	バイオ材料(タンパク質など)の選択的修飾技術	(独)産業技術総合研究所 バイオニクス研究センター研究員 鈴木 祥夫
13:55～14:15	ナノ材料(CNTなど)の選択的修飾技術	(独)産業技術総合研究所 ナノカーボン研究センターチーム長 畠 賢治
14:15～14:35	多層ウエハレベル接合体の低ストレスダイシング技術	(財)レーザー技術総合研究所 主任研究員 藤田 雅之
14:35～14:45	休憩	
<b>セッション3</b>	<b>ファインMEMSプロジェクト委託事業の成果発表(2)</b>	司会:ファインMEMSプロジェクトプロジェクトリーダー 立命館大学 教授 杉山 進
14:45～15:05	ファインMEMSシステム化設計プラットフォームの開発	静岡大学 電子工学研究所 教授 橋口 原
15:05～15:25	MEMS・半導体プロセス統合モノリシック製造技術(新たなセンシング原理の探求)	立命館大学 理工学部 教授 鳥山 寿之
15:25～15:45	MEMS・半導体横方向配線技術(高密度な低温積層一体化実装技術)	(独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 グループ長 明渡 純
15:45～16:05	MEMS・半導体横方向配線技術(高密度な低温積層一体化実装技術)	東北大学 工学研究科 教授 小柳 光正
16:05～16:15	ファインMEMS知識データベースについて	(財)マイクロマシンセンターMEMSシステム開発センター 逆水登志夫
<b>クロージング</b>		
16:20～16:30	閉会の挨拶	(財)マイクロマシンセンター 専務理事 青柳 桂一

## マイクロナノ2008「MEMSフォーラム」

### (1) 開催主旨

MEMSフォーラムは、MEMS関連産業の拡大・発展のための課題の共通認識を深めることを目的とした、MEMS協議会の諸活動の情報発信・意見交換の場です。MEMS産業基盤の構築、産学連携によるMEMS技術基盤構築・展開の観点から、MEMS協議会及びアフィリエートメンバー(地域クラスター、公設試、アカデミア)の活動状況を紹介します。

### (2) プログラム

## マイクロナノ2008 MEMSフォーラム

- MEMS産業の発展を目指して -

開催日時 2008年8月1日(金)10:30～16:35  
 開催場所 東京ビッグサイト 西1ホール 第19回マイクロマシン/MEMS展会場内 特設会場  
 主催 MEMS協議会/(財)マイクロマシンセンター  
 参加費 無料  
 司会:(財)マイクロマシンセンター 阿出川 俊一

<b>オープニング</b>		
10:30～10:35	開会挨拶	MEMS協議会 副会長 オムロン(株)執行役員常務 技術本部長 今仲 行一
<b>セッション1</b>	<b>MEMS産業・技術の高度化に向けて</b>	
10:35～10:50	MEMS協議会活動の概要	(財)マイクロマシンセンター専務理事 MEMS協議会事務局 青柳 桂一
10:50～11:20	MEMS産業の基盤強化に向けて	MEMS協議会 副会長 東京大学大学院 情報理工学系研究科 研究科長 教授 下山 勲
11:20～11:40	MEMS市場拡大に向けて - 第1世代MEMS～第3世代MEMS(BEANS) -	(財)マイクロマシンセンター 調査研究/国際担当部長 安達 淳治
11:40～12:00	MEMS分野の技術戦略ロードマップ	(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 機械システム技術開発部 主査 渡辺 秀明
12:00～13:10	昼食・休憩	
<b>セッション2</b>	<b>産学連携セッション</b>	オーガナイザー:名古屋大学大学院工学研究科 教授 佐藤 一雄
13:10～13:20	産学連携セッション開催にあたり	名古屋大学大学院工学研究科 教授 佐藤 一雄
13:20～13:40	安全・安心な社会を実現する先進的統合センシング技術:人体装着超小型センサー	兵庫県立大学 教授 前中 一介
13:40～14:00	超精密マイクロ3次元機械加工による次世代光学素子の量産化	名古屋大学 教授 社本 英二
14:00～14:20	日本機械学会マイクロ・ナノ工学専門会議 マイクロエネルギー研究所の紹介	日本機械学会マイクロ・ナノ工学専門会議 マイクロエネルギー研究会 委員長 東北大学 教授 桑野 博喜
14:20～14:30	休憩	
<b>セッション3</b>	<b>MEMS産業発展の課題</b>	
14:30～14:50	MEMS分野の国際標準化動向	国際標準化工学研究所代表 帝京大学理工学部情報科学科 教授 大和田邦樹
14:50～15:10	マイクロナノ製造人材育成への産総研の取組 - 産学人材育成パートナーシップ事業を中心に -	(独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 主幹研究員 前田龍太郎
15:10～15:30	MEMSファンドリー基盤強化	立命館大学 COE推進機構 教授 杉山 進
15:30～15:50	MEMSファンドリーネットワーク構築に向けた活動紹介	MEMS協議会ファンドリーサービス産業委員会 委員長 オムロン(株)エレクトロコンポーネンツビジネスカンパニー MEMS開発部長 佐藤 文彦
15:50～16:10	MEMS技術を用いた神奈川県産業技術センターの研究開発支援事例	神奈川県産業技術センター 電子技術部電子材料チーム 主任研究員 安井 学
16:10～16:30	MemsONE(MEMS用設計・解析支援システム)Ver.1.1の機能紹介と今後の予定	MemsONEコンソーシアム 日本ユニシス・エグゼキュティブズ(株)研究開発部MEMSプロジェクト 担当部長 前田 幸久
<b>クロージング</b>		
16:30～16:35	閉会挨拶	(財)マイクロマシンセンター専務理事 MEMS協議会事務局 青柳 桂一